定される機会に、単位の

|の参加を呼びかけてい

~17時(受付開始12時15

30) 年12月2日(1、13時

【日時】2018 (平成

育関係者、技術者等など 議は、学生、研究者、教 を開催する。日本学術会

の定義の改定が討議・決

の4つの単位(質量、電

開催の国際度量衡総会

産総研講師も講演

で、国際単位系(SI)

| く展望するシンポジウム

合研究所計量標準総合セ

で(件名:日本学術会議

【申込方法】電子メール

日本化学会、産業技術総

【共催】日本物理学会、

ンター

|の原理や科学技術の発 |展、今後の進展などを広

制定の背景にある、自然

る。

第 3212 号

厚さ測定用両面干渉計を開発

長さの国家標準にトレーサブルな

準研究グループ平井亜紀 研究部門ナノスケール標

(産総研) 工学計測標準 産業技術総合研究所

子研究グループ長と長さ

きる厚さ測定用両面干渉

は、分光干渉方式が広く

の幾何学的厚さを直接求

ており、シリコンウエ

厚さの非接触測定に

さの国家標準にトレーサ

研究グループ長は、長

エハーの厚き測定に応用 計を開発し、シリコンウ

ブルに試料厚さを測定で

標準研究グループ尾藤洋

日本学術会議公開シンポジウム

18/)

【問い合わせ先】 産業技

/scj-symposium_20

号の決定および原子量の

研究所香取量子計測研究

い国際単位系(SI)重さ、電気、温度

て時間の計測と私たちの暮らし

12月2日日、日本学術会議講堂で

計測と科学

東京都千代田区神田錦町 3-11-8 (武蔵野ビル) 〒 101-0054 TEL 03-3295-7871 http://www.keiryou-keisoku.co.jp/



寄稿(横田貞一・児玉功)

日本学術会議公開シンポジウム開催、

ミツトヨ新製品、JCSS登録と更新、社説 資料・指定検定機関の申請方法⑴~⑸

学術会議連携会員、化学 委員会IUPAC分科 古屋大学名誉教授、日本 新たな表記」異和行(名 ▽15時45分~16時 重力波天文学」三代木伸 室主任研究員 「精密時空時計測が拓く (東京大学宇宙線研究

台センター計量標準普及

=電話029―861―

位系に支えられる物性物 ▽14時20分~14時50分 「新単位系を支え、新単 ▽16時15分~16時45分 所准教授)

らした長さ計測の進展」 美濃島薫(電気通信大学 工学専攻教授、日本学術 情報理工学研究科基盤理

〈計測と科学〉

日本学術会議は、12月2日日、東京都港区の日

の計測と私たちの暮らし」を開催する。参加は無 際単位系(SI)重さ、電気、温度、そして時間 本学術会議講堂で、公開シンポジウム「新しい国

理学委員会·総合工学委

【参加費】無料

(主催) 日本学術会議 物

すぐ

員会合同IUPAP分科

会、化学委員会IUPA

し込みが300名に満た

長、国際度量衡委員)

【定員】先着300名(申

ない場合は当日受付も実

藤井賢一)も講演する。 MIJ) の講師 (臼田孝、

量標準総合センター(N

堂(東京都港区六本木7一

■プログラム

学物性研究所教授、物理

理学」勝本信吾(東京大

【場所】日本学術会議講

j-2018-ml@aist.go.j

-22-3、東京メトロ千

代田線乃木坂駅 5番出口

産業技術総合研究所計

会議連携会員、

構素粒子原子核研究所教 あいさつ」野尻美保子(高 ▽16時45分~16時55分 エネルギー加速器研究機 ▽16時55分~17時「閉会 「質疑応答」

改定の歴史、今回の改定 | 合センター総合センター ▽13時~13時20分「標準 術総合研究所計量標準総 学会理事) デジタルスケ

|▽13時20分~13時50分 定義改定が拓く新しい計 国際単位系(SI)の ▽14時50分~15時 「質疑

▽15時15分~15時45分 学大学院工学系研究科物 使う」香取秀俊(東京大 ▽15時~15時15分「休憩」 「新しい時間をつくる、

ttps://www.nmij.jp @aist.go.jp′ 詳細:h 送信先:scj-2018-ml /public/event/2018 | 「新元素の名前と化学記 公開シンポジウム申込、 ▽13時50分~14時20分 |総合センター首席研究 員、CODATA委員) 技術総合研究所計量標準 一理工学専攻教授、理化学

果の信頼性が保証できな 用いられているが、これ までは試料内部の屈折率 に影響されるため測定結 める。試料内部を透過し

台の光干渉計で試料両側 射光だけを使用して、2 れらを組み合わせて試料 の表面形状を測定し、そ は、可視光を用い表面反 今回開発した技術で の周波数安定化レーザー にトレーサブルな複数台 果も国家標準にトレーサ を可視光の光源として用 いるため、厚さの測定結 また、長さの国家標準

ない。 た光は使用しないので、 試料の屈折率に影響され

シリコンウエハーの厚さを高精度に測定

この技術により厚さが

1つ。近年、測定結果の り、厚さは重要な項目の 頼性が向上する。 われている測定装置を校 いて製造現場ですでに使 の寸法の規格を定めてお 団体がシリコンウエハー 測定された標準試料を用 信頼性が一層重要になっ 半導体製造では、業界 となっていることに応え いる。 コンウエハーではこれま れ、厚さ管理は一層重要 で以上の薄さが求めら めの三次元積層用のシリ

ティへの要求が高まって 標準へのトレーサビリ ハーの厚さ測定でも国家 合工学委員会合同IUP 会員、物理学委員会・総 AP分科会委員長) 「長さの定義改定がもた また、集積度向上のた 新しいコンビ機の登場です。

ノい金属検出機、ウェイトチェッカをお届けし



台の中に省スペー -スで実現

ウェイトチェッカ **WCMシリーズ**

本社/〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 Tel.03(5391)6128(直) 札幌011-251-2753/仙台022-211-8051/宇都宮028-610-0377/東京北048-592-3111 東京南045-476-5231/静岡054-286-2880/名古屋052-726-8760/大阪06-7668-3900 広島082-233-0611/福岡092-441-6715 http://www.aandd.co.jp